

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年9月10日(10.09.2021)



(10) 国際公開番号

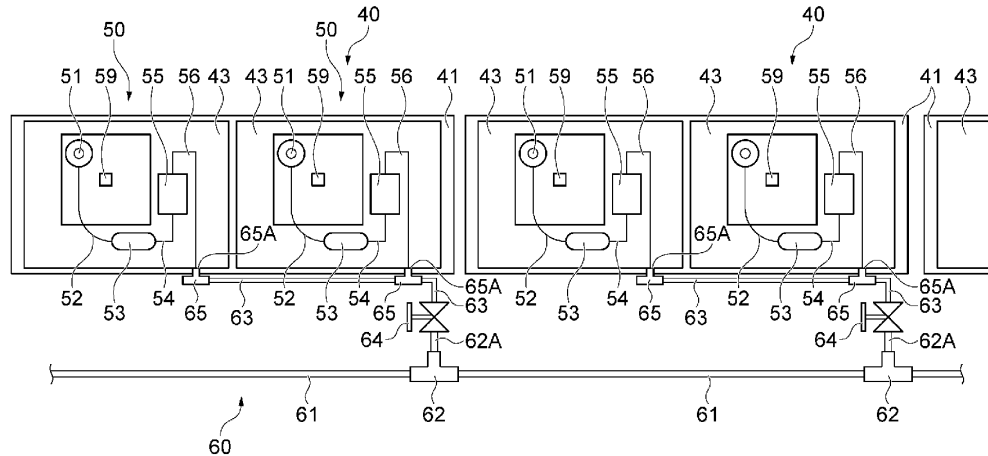
WO 2021/176865 A1

- (51) 国際特許分類:
B65G 1/14 (2006.01) *H01L 21/673* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/001632
- (22) 国際出願日: 2021年1月19日(19.01.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-037929 2020年3月5日(05.03.2020) JP
- (71) 出願人: 村田機械株式会社 (MURATA MACHINERY, LTD.) [JP/JP]; 〒6018326 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 椿 達雄 (TSUBAKI Tatsuo); 〒5160003 三重県伊勢市下野町600-10 村田機械株式会社伊勢事業所内 Mie (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiaki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: STORAGE SHELF

(54) 発明の名称: 保管棚

[図2]



(57) Abstract: A storage shelf (1) provided with: a main body frame (10); a plurality of shelf modules (40) which each have a base plate (41) removably provided to the main body frame (10) and a supply nozzle (51) attached to the base plate (41); a main pipe (61) through which flows a purge gas supplied from a supply source; and a first branching parts (62) which are provided to the main pipe (61) and which branch a flow channel from the main pipe (61), wherein each shelf module (40) is provided with a flow control device (55) which adjusts the flow of the purge gas supplied from the supply nozzle (51), each first branching part (62) is connected to a respective module pipe (63) via an open/close valve (64) that opens/closes the flow channel, and each flow control device (55) is connected to a respective module pipe (63).

[続葉有]

WO 2021/176865 A1

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 保管棚(1)は、本体フレーム(10)と、本体フレーム(10)に着脱可能に設けられるベースプレート(41)と、ベースプレート(41)に取り付けられた供給ノズル(51)と、を有する、複数の棚モジュール(40)と、供給源から供給されるバージガスが流通するメイン配管(61)と、メイン配管(61)に設けられると共にメイン配管(61)から流路を分岐させる第一分岐部(62)と、を備え、棚モジュール(40)には、供給ノズル(51)に供給するバージガスの流量を調整する流量制御装置(55)が設けられており、第一分岐部(62)には、流路を開閉する開閉バルブ(64)を介してモジュール配管(63)が接続され、流量制御装置(55)は、モジュール配管(63)に接続されている。